

装置と場所の対応表 Equipment and Location Correspondence Table

共通機器センター Shared Research Facilities

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name	
1	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ	X線回折装置 XRD	Ultima IV (Rigaku)	
2		テクノプラザ	X線回折装置 XRD	SmartLab (Rigaku)	
3		テクノプラザ	走査型電子顕微鏡 SEM	汎用SEM 6010LV (JEOL)	
4		テクノプラザ5(01132室)	Scanning Electron Microscope	新分析SEM with EDS (JEOL/JSM-IT510LA)	
5		テクノプラザ	電界放出型走査電子顕微鏡 FE-SEM	FE-SEM JSM-7610 (JEOL)	
6		テクノプラザ	Field Emission-type SEM	FE-SEM JSM-7100 (JEOL)	
7		テクノプラザ2*	電子線マイクロアナライザ EPMA	EPMA-8050G (Shimadzu)	
8		テクノプラザ	熱重量差分析装置 TG-DTA	TG-DTA2020SA (BRUKER AXS)	
9			精密熱重量分析装置 TGA	TGA5000 (ティ・エイ・インスツルメント)	
10			レーザー顕微鏡	OLS4000 (Olympus)	
11			Laser Microscope	OLS5100 (Olympus)	
12			デジタルマイクロスコープ	VH-Z100UR (KEYENCE)	
13			プローブ顕微鏡	汎用AFM AFM5000 II (HITACHI)	
14			Probe Microscope	高性能AFM SPM8000-FM (Shimadzu)	
15			光学顕微鏡 & 実体顕微鏡	BX51 (Olympus) & S7-TP520-EA10-56 (SWIFT)	
16			引張圧縮試験機	AG-50kNX (Shimadzu)	
17			ゼータ電位・ナノ粒子径測定システム	DelsaMax PRO (BECKMAN COUTER)	
18			顕微ラマン分光装置	LabRAM HR Evolution (HORIBA)	
19			分析解析センター3 12F30	分光エリプソメーター	RC2-DI-SUY (J.A.Woollam社 ジェー・イー・ウーラム・ジャパン)
20			テクノプラザ	フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR	IRAffinity-1S (Shimadzu)
21				Fourier Infrared Spectrometer	
22		顕微フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR		FT-IR-4X + IRT-5200 (Jasco)	
23		Fourier Infrared Spectrometer			
24		紫外可視分光光度計		V630-BIO (Jasco)	
25		UV-Vis Spectrophotometer			
26		テラヘルツ分光光度計		VIR-F (Jasco)	
27		Terahertz Spectrophotometer			
28		分析解析センター3 12F30	紫外可視赤外分光光度計	UV-3600 Plus (Shimadzu)	
29			UV-Vis-NIR Spectrophotometer		
30		分析解析センター3 12F30	分光蛍光光度計	FP-6300 (Jasco)	
31			Spectrofluoro-Photometer		
32		テクノプラザ	4探針法抵抗率測定器	RT-70V (ナブソン株式会社)	
33			Measuring instrument of resistivity by 4 point probe method		
34		テクノプラザ	X線CTスキャン	μ Ray8700 (Matsusada)	
35		テクノプラザ2*	X-ray CT Scan		
36		テクノプラザ2*	スパッタリング装置	CFS-4ES II (SHIBAURA MECHATRONICS)	
37		テクノプラザ	Sputtering Equipment		
38		テクノプラザ	サーマルマネキン	TM8-22R (PT-Teknik)	
39		分析解析センター3 12F30	自動接触角測定装置	OCA15EC (Dataphysics Instruments GmbH)	
40			Contact angle measuring device		
41		09I25 クリーンルーム	窒素吸着比表面積細孔分布測定装置	Belsorp II mini (MicrotracBEL Corp.)	
42			Adsorption Measurement		
43		分析解析センター3 12F30	マスクレス露光装置	DL-1000GS/SS (NanoSystem, 9Fクリーンルーム)	
44			Maskless Lithography System		
45		分析解析センター3 12F30	偏光ゼーマン原子吸光度計	Z-2300 (HITACHI)	
46	Polarized Zeeman atomic absorption spectrophotometer				
47	13G27-b	質量分析計	AXIMA-CFR+(plus) (SHIMADZU)		
48		Mass Spectrometer			
49	分析解析センター3 12F30	大気圧イオン化高分解能飛行時間型質量分析計	JMS-T100LP (JEOL)		
50		Mass Spectrometer			
51	分析解析センター3 12F30	円二色性分散計	J-820 (JASCO)		
52		Circular dichroism spectrometer			
53	分析解析センター2 11B27	核磁気共鳴装置	JNM-ECZL400R (JEOL)		
54		Nuclear Magnetic Resonance, NMR			
55	テクノプラザ5(01132室)	真空加熱蒸着装置	SVC-700T (SANYU ELECTRON)		
56		Vacuum Evaporation System			
57	テクノプラザ2*	電子ビーム蒸着装置	SVC-700LEB (SANYU ELECTRON)		
58		Electron Beam Evaporation System			
59	テクノプラザ2*	シリコン深掘り装置 (Deep RIE)	MUC21 ASE-SRE (SPP technologies)		
60		Silicon Deep Reactive Ion Etching Machine			
61	テクノプラザ2*	スピコーター	ACT-300A II (株式会社アクティブ)		
62		Spin Coater			
63	テクノプラザ2*	プラズマ微細加工装置	TEP-01x (立山マシン株式会社)		
64		Plasma microfabrication equipment			
65	テクノプラザ5(01132室)	その他MEMS関連装置群 (スピコーター, ホットプレート, 乾燥器等)	-		
66		Spin Coater etc. for MEMS			
67	テクノプラザ5(01132室)	小型無冷媒型 PPMS	VersaLab TM (Quantum Design)		
68	分析解析センター3 12F30	半導体パラメータアナライザ	4156B (Hewlett packard)		

46	テクノプラザ2*	手動回転研磨機 Rotary Polishing Machine	LaboPol-30 (Struers)		
47		分析解析センター3 12F30	純水製造装置 Pure water production equipment	WE200 (Yamato)	
48			ソフトプラズマエッチング装置 Soft Plasma Etching Device	SEDE-GE (メイワフォーシス株式会社)	
49		テクノプラザ	アクティブラーニングスペース Active Learning Space	打ち合わせスペース Meeting space	
50			テクノ工房 Techno Studio		
51			低速切断機アイソメット Low speed cutting machine	Isomet (Buehler)	
52			恒温振とう培養器 Homeothermic shaking incubator	BR-11FP (タイテック)	
53			小型電気炉 Small electric furnace	HPM-1N (As one)	
54			小型熱プレス機 Small heat press machine	AH-2003 (As one)	
55			テクノプラザ4	レーザー加工機 大型 (A1サイズまで) Laser cutting machine	Speedy400 (Trotec Laser) 100W
56				レーザー加工機 小型 (A3サイズまで) Laser cutting machine	Rayjet 50 (Trotec Laser)
57		樹脂用簡易CNC切削機		MODELA model MDX-40 (ローランド ディージー)	
58		熱溶解積層型3Dプリンタ Fused Deposition Modeling 3D Printer		Ender-3 V3 SE (Creality) Ender-3 S1 Plus (Creality)	
59		大宮校舎 Omiya campus	101-2	走査型電子顕微鏡 SEM Scanning Electron Microscope	新分析SEM with EDS (JEOL/JSM-IT510LA)
60	202		透過型電子顕微鏡TEM TEM (Transmission Electron Microscope)	JEM-2100 (JEOL)	
61			(新)集束イオンビーム加工装置 FIB (Focused Ion Beam)	MI-4050 (日立ハイテック)	
62			(旧)集束イオンビーム加工装置 FIB (Focused Ion Beam)	FB-2000A (日立ハイテクノロジ)	
63			X線回折装置 XRD (X-ray Diffractometer)	SmartLab (Rigaku)	
64			単結晶X線構造解析装置 Single-Crystal Xray Diffraction	D8 QUEST (ブルカー・ジャパン)	
65			窒素水蒸気吸着比表面積測定装置 Adsorption Measurement	Belsorp MaxII (MicrotracBEL Corp.)	
66			真空蒸着装置 Vacuum Evaporation System	JEE-400 (JEOL)	
67			ウルトラミクロトーム Ultra microtome	EM-ULTRACUT UCT (ライカ)	
68			精密研磨装置 Polisher	ダイヤラップML-150P (マルトー)	
69			マニュアルプローバー Manual prober	705B (日本マイクロニクス)	
70			ピコ秒蛍光寿命測定装置	G11200 (浜松ホトニクス)	
71			絶対PL量子収率測定装置	C9920-02G (浜松ホトニクス)	
72			半導体パラメータアナライザ	4145B (Hewlett packard)	
73			101-1	光学顕微鏡 Optical microscope	ECLIPSE LV100ND (ニコン)
74	ナノインプリント装置 Nanoimprint equipment			LTNIP-5000 (リソテック)	
75	超臨界乾燥装置 Supercritical dryer			SCRD4 (レクザム)	
76	熱処理装置 Heat treatment equipment			GFA430VN (サーモ理工)	
77	スピナー Spin coater			ACT-300A II (アクティブ)	
78	膜厚計測装置 Film thickness measuring device			FE-300 (大塚電子)	
79	超音波ホモジナイザー Ultrasonic homogenizer			UP-50H (ヒールツィヤー)	
80	104			プロトンビームライター PBW (Proton Beam Writer)	MBS-1000 (神戸製鋼所)
81	104-1			電子スピン共鳴装置 Electron Spin Resonance Spectrometer	JES-X310 (JEOL)
82	104-3			無電解メッキ装置 Electroless metal plating equipment	A-50 (山本鍍金試験器)
83	105		超伝導量子干渉磁束計 SQUID Superconducting quantum interference device	MPMS-XL (日本カンタムデザイン)	
84	107		核磁気共鳴装置 NMR (Nuclear Magnetic Resonance)	JNM-ECZL400R (JEOL)	
85	301		LC-MS (高速液体クロマトグラフィー-QTRAP 型質量分析装置) Liquid chromatography mass spectrometer	QTRAP® 5500 LC-MS/MS (AB Sciex Pte. Ltd.)	
86			セルソーター (フローサイトメーター) Cell Sorter	BD FACSAria III (日本ベクトン・ディッキンソン)	
87	303		超純水製造装置 Ultrapure water production equipment	Direct-Q UV (メルク)	
88			放電プラズマ焼結 (SPS) 装置 Spark plasma sintering equipment	LABOX-210 (シンターランド)	

*テクノプラザ2とは、交流棟1階 テクノプラザ3室隣の部屋です。
Technoplaza 2 is located next to Technoplaza3 on the first floor of Kouryu-bulding.

ものづくりセンター Manufacturing Center

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name
89	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ3	立形マシニングセンタ Vertical Machining Center	MB-46VA (オークマ)
90			射出成形機 Injection Molding Machine	NPX7-1F (日精樹脂工業株)
91			バンドソー、コンターマシン Contour machine	NCC-300LE (ニコテック)
92			ファインカッター高速切断機 High-speed cutting machine	HS45A型Cタイプ (平和テクニカ)
93			CNCワイヤー放電加工機 CNC wire electric discharge machine	VL400Q (ソディック)
94			卓上フライス盤 Bench type milling machine	YS300MT (東和精機)
95			卓上旋盤 Bench lathe	YS550V (東和精機)
96			油圧プレス (5t) Hydraulic press	HYP-505H (JAM)
97			ビッカース硬さ試験機 Hardness testing machine	アカシ (ミットヨ)
98			オートグラフ Universal testing machine	AG-20kNG (島津製作所)
99			ベンチグラインダ Bench grinder	FG255T (YODOGAWA)
100			圧入機 Press fitting machine	渡辺機械
101			バンドソー Band Saw	K-100 (ホーザン)
102			ボール盤 Drilling machine	TB131 (マキタ) DP3050R (REXON)
103	タッピング盤 Tapping machine	KRT-10 (キラ・コーポレーション)		
104	大宮校舎 Omiya campus	4号館4102室	マシニングセンタ	V33i (MAKINO)
105			ターニングセンタ	LB3000EX II (okuma)
106			フライス盤	AM103 (DMGMORI)
107			フライス盤	NK-1R (IWASHITA)
108			旋盤	MATE-570S (ヤマザキマザック)
109			帯鋸盤	CRA-300 (AMADA)
110			コンタマシン	U-500 (LUXO)
111			ボール盤	ESD-460 (遠州工業)
112	4号館4101室		芝ミル(樹脂&低負荷金属用卓上CNCフライス) ※3台中2台は4101室、1台は豊洲テクノプラザ4に設置	向島テック
113			卓上旋盤	L5200型S (コスモキカイ)
114			卓上フライス盤	FK-500S (コスモキカイ)
115			卓上ボール盤	大西機械設計
116			バンドソー	BS23 (東洋アソシエイツ)
117			ベルトグラインダー	BGM-50 (日立工機)